



DKZ/7/2008

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2008 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę spektrometru ramanowskiego do badań naprężeń w warstwach półprzewodnikowych i dielektrycznych struktur półprzewodnikowych nowej generacji oraz do wyznaczania ich składu chemicznego.

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w dniu 31 marca br. odpowiadamy na pytania dotyczące siwz.

1. *Czy Zamawiający w ocenie technicznej będzie premiował lepszą rozdzielczość spektralną niż wymagana?*

Wyższa spektralna zdolność rozdzielcza niż żądana będzie premiowana w pozycji „Inne” SIWZ.

2. *Czy Zamawiający w ocenie technicznej będzie premiował chłodzenie kamery do temperatury niższej niż wymagana (-70 °C)?*

Według naszych doświadczeń prowadzonych na dostępnych nam spektrometrach temperatura -70°C jest wystarczająca dla naszych celów, nie przewidujemy więc premiowania chłodzenia kamery do temperatury niższej niż wymagana w SIWZ.

3. *W związku z pytaniem 1 czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery CCD o wielkości elementu 13.5x13.5 μm (oczywiście z możliwością binningu sygnału z dwóch sąsiednich elementów)?*

Dopuszczamy zastosowanie kamery CCD o wielkości elementu 13.5x13.5 μm.

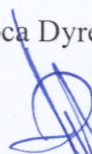
4. *Czy oferta musi zawierać optyczne elementy do skupiania wiązki lasera? Z odpowiedzi na dotychczas zadane pytania wnioskuję, że elementy te mogą być oferowane w pozycji inne i nie są wymagane wg SIWZ.*

Oferta musi zawierać elementy optyczne sprzęgające laser ze spektrometrem oraz inne zespoły optyczne do skupiania promieniowania laserowego.

5. Czy określenie „zautomatyzowany system” możemy rozumieć jako automatyczne wykonywanie analiz umożliwiających akwizycję obrazów, map i widm ramanowskich na wielu próbkach i/lub zdefiniowanych wielu obszarach oraz automatyczną możliwość dostrajania autofocusem mikroskopu do wysokości każdej z próbek?

Określenie „zautomatyzowany system” należy rozumieć jako możliwość akwizycji obrazów, map i widm Ramana dla jednej próbki w jednym zdefiniowanym obszarze. Odnośnie zapytania o możliwość dostrajania mikroskopu autofocusem do aktualnej grubości próbki wyjaśniamy, że chodzi o mapping w osi z.

Zastępca Dyrektora



Mgr inż. Zbigniew Poznański